

# 抵抗加熱式蒸着装置

## ■ 用途

制御系一体のコンパクトな汎用バッチ式蒸着装置です。

金属膜用電源、有機膜用電源を併せて構成可能にしており、多様な蒸着膜の作製が行えます。

直感的に操作が行える手動装置の為、簡易的な実験を行う研究室、教育機関で活躍しています。

【導入分野】 研究開発、試作品開発



## ■ 特徴

抵抗加熱式の蒸着装置となっており、金属膜、有機膜を作製することができます。

SUS製チャンバを採用、前面解放型のアクセスドアにより、試料や蒸着材料の交換が容易に行えます。

蒸着源は最大3元、蒸着用電源は金属膜用・有機膜用から最大2式の構成を可能としており、蒸着源と電源の組み合わせを選択頂けます。※

多層膜蒸着、基板回転、膜厚制御などの選択を可能としており、高い拡張性を有しています。

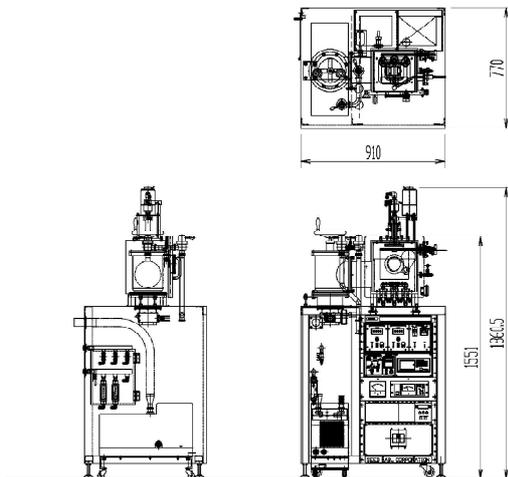
成膜ステージは水冷ステージを標準採用し、最大4インチ基板に対応します。

※金属膜用、有機膜用の電源を各1式構成した場合、同時成膜はできません。

## ■ 仕 様

### 抵抗加熱式蒸着装置

排気性能	到達圧力	$\leq 5.0 \times 10^{-4}$ Pa	機能	成膜ステージ	水冷 Rotary (自転)
	排気時間	$\leq 1.0 \times 10^{-3}$ Pa 60 min 以内		シャッター	手動 基板直下
真空槽	真空槽	SUS 製チャンバ / (W×D×H) =280mm×270 mm×350mm	制御系	主操作	手動 制御盤 各種操作パネル
	基板/電極間距離	200 mm (固定)	オプション	膜厚制御	水晶振動子式膜厚計 電源停止 連動機能
排気系	主排気ポンプ	ターボ分子ポンプ (空冷)		排気バルブ	自動バルブ
	補助ポンプ	ドライ真空ポンプ or 油回転ポンプ	ユーティリティ	電力・接地	主電源系 3φ AC200V 40A 50/60 Hz
	各種バルブ	手動操作		冷却水	供給圧 : 0.2 ~ 0.3 MPa 水温 : 20 ~ 35 °C 水量 : $\geq 5$ L/min
真空計	低真空	ピラニ真空計		ベントガス	窒素ガス 0.1 ~ 0.15 MPa
	高真空	電離真空計		圧縮空気 ※オプション選択時	0.5 ~ 0.8 MPa
基板・電極	基板サイズ	MAX 4 インチ (角型 100 mm×100mm 可能)	設置面積	(W×D×H) =900mm×800mm×1900mm	
	蒸発電極(無機)	最大 3 点切替式 切替スイッチ付属	重量	装置本体 : 500 kg	
	蒸発電源(有機)	最大 3 点切替式 切替スイッチ付属			
	蒸発電源(無機)	SCR コントローラ/トランス 電圧 : 0~10 V、電流 : 0~200A			
	蒸発電源(有機)	SCR コントローラ/トランス 電圧 : 0~10 V、電流 : 0~50A			
槽内アクセス	アクセスドア	Oリングシール			



## ■ 株式会社 日本シード研究所

本社・工場 : 〒252-1125  
神奈川県綾瀬市吉岡東 2-3-27

電話 : 0467-77-4351

FAX : 0467-77-9858

URL : <https://www.seed-lab.com>

※外観・仕様については改善のため予告なく変更することがあります。  
2024.11